

NIMS微細構造解析プラットフォーム装置利用料金表(消費税別)

2020.11.09

| 種別 | 装置名(型式) | 場所 | 利用形態 | 課金単位 | 機器利用(1hあたり) | | | 技術補助(1hあたり) | | | 技術代行1(1hあたり) | | | 技術代行2(1hあたり) | | | 技術代行3(1hあたり) | | |
|-------|--|----|------------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | | | | | 大学・公的機関 | 中小企業 | 大企業 | 大学・公的機関 | 中小企業 | 大企業 | 大学・公的機関 | 中小企業 | 大企業 | 大学・公的機関 | 中小企業 | 大企業 | 大学・公的機関 | 中小企業 | 大企業 |
| TEM千現 | 実動環境対応物理分析電子顕微鏡(JEM-ARM200F-G) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 6,100 | 12,200 | 18,300 | 6,310 | 12,620 | 18,930 | 8,200 | 16,400 | 24,600 | 10,300 | 20,600 | 30,900 |
| TEM千現 | 実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡(JEM-ARM200F-B) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 6,100 | 12,200 | 18,300 | 6,310 | 12,620 | 18,930 | 8,200 | 16,400 | 24,600 | 10,300 | 20,600 | 30,900 |
| TEM千現 | 300kV電界放出形透過電子顕微鏡(Tecnai G2 F30) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 5,100 | 10,200 | 15,300 | 5,310 | 10,620 | 15,930 | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 9,300 | 18,600 | 27,900 |
| TEM千現 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1, JEM-2100F2) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 4,100 | 8,200 | 12,300 | 4,310 | 8,620 | 12,930 | 6,200 | 12,400 | 18,600 | 8,300 | 16,600 | 24,900 |
| TEM千現 | 200kV透過電子顕微鏡(JEM-2100) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |
| TEM千現 | 走査電子顕微鏡(JSM-7000F) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |
| TEM千現 | FIB加工装置(JIB-4000, JEM-9320FIB, JEM-9310FIB1, JEM-9310FIB2) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |
| TEM千現 | デュアルビーム加工観察装置(NB5000) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | セッション(3.5h) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 5,100 | 10,200 | 15,300 | 5,310 | 10,620 | 15,930 | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 9,300 | 18,600 | 27,900 |
| TEM千現 | ピックアップシステム(Pickup system) *15分単位での利用可 | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | 時間(1h) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |
| TEM千現 | TEM試料作製装置群(TEM sample preparation apparatus) | 千現 | 機器利用・技術補助 技術代行・共同研究 | 時間(1h) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |
| TEM千現 | ウルトラミクローム(Leica EM UC6) | 千現 | 技術補助・技術代行 共同研究 | 時間(1h) | - | - | - | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |
| TEM千現 | HRTEM解析システム HRTEM Analysis system | 千現 | 技術補助・技術代行 共同研究 | 時間(1h) | - | - | - | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |
| TEM千現 | 電子線トモグラフィー解析システム Electron tomography analysis system | 千現 | 技術補助・技術代行 共同研究 | 時間(1h) | - | - | - | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 3,310 | 6,620 | 9,930 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 7,300 | 14,600 | 21,900 |

【その他の支援】

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|------|--------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| TEM千現 | 解析 *15分単位での利用可 | 千現 | 技術代行 | 時間(1h) | - | - | - | - | - | - | 2,100 | 4,200 | 6,300 | - | - | - | - | - | - |
| TEM千現 | 技術指導料 *15分単位での利用可 | 千現 | 技術補助 | 時間(1h) | - | - | - | 2,100 | 4,200 | 6,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※技術代行の料金設定は、難易度によって3種類に分かれています
標準的な作業の場合は2が適用されます